

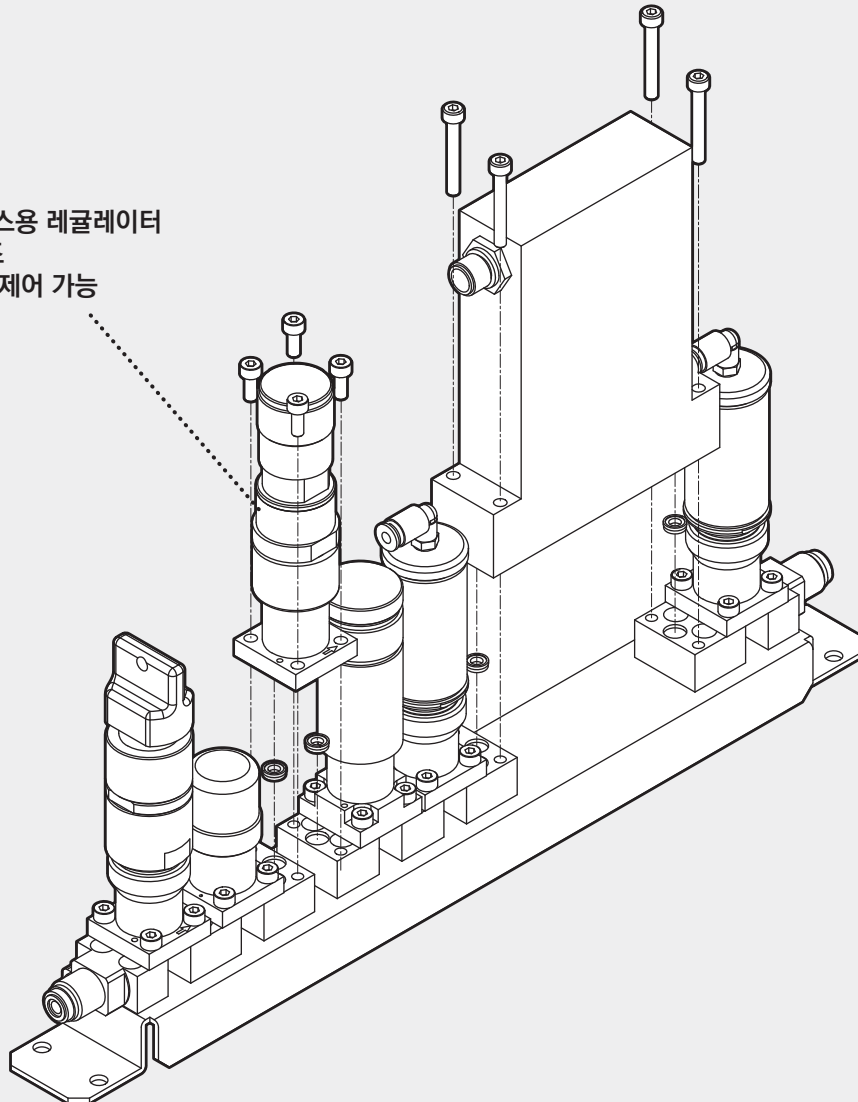
공간 절약, 유지 관리성 한번에 대폭 향상

개요

본 시스템은 반도체 제조 장치의 가스 공급 라인용으로 개발되었으며 SEMI로 규격화된 서페이스 마운트형 에어 오퍼레이터 밸브·매스플로 컨트롤러 등을 콤팩트하게 집적화한 제품입니다.

고객이 원하는 플로에 맞춰 최적의 레이아웃을 실시하여 기존의 용접 피팅으로 구성한 시스템에 비해 공간을 대폭 절약할 수 있습니다.

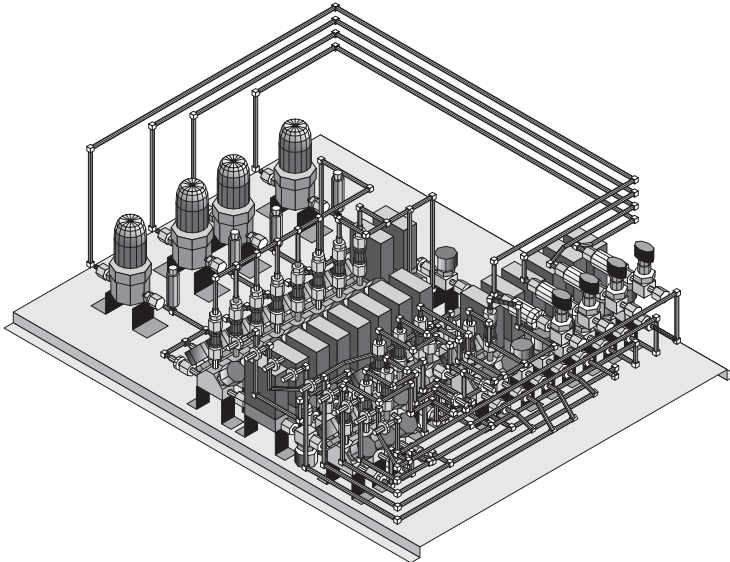
- 프로세스 가스용 레귤레이터
PGM 시리즈
고정도 압력 제어 가능



PAT.

주요 특징

기존 가스 정글



풋 프린트 감소

- 풋 프린트 기존 대비 60%
- 용적 기존 대비 16%

시공성 향상

- 구성 부품 상부 한 방향에서 부품 탈착 가능
- 히팅 간소화

신뢰성 향상

- CS Seal/W Seal 채용

내식성 향상(오염 없음)

- 용접 부분 80% 이상 감소
용접부를 대폭 줄여 기존에 비해
오염 요인이 대폭 감소하였습니다.

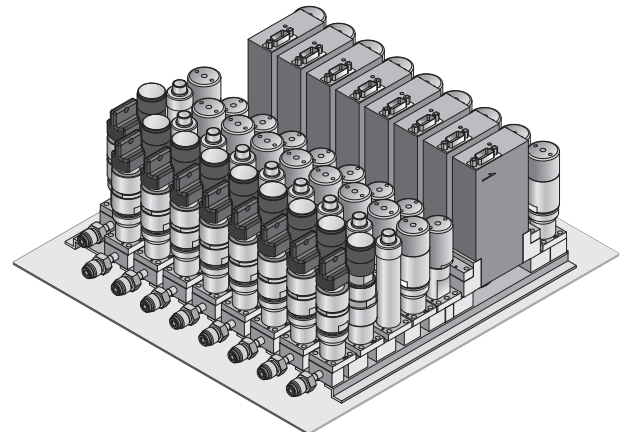
치환 특성 향상

- 내부 용적, 데드 볼륨을 최소화한 유로 구성
- 퍼지 개선

표준화 추진

- 구성 부품의 표준화 추진

집적화 가스 공급 시스템



Integrated Gas System Series

집적화 가스 공급 시스템 히스토리

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008

LG D 시리즈

AGD / OGD / MGD R 시리즈

고내구 타입

기타 프로세스 가스용 밸브

레귤레이터

집적화 가스 공급 시스템

사용상의 주의사항

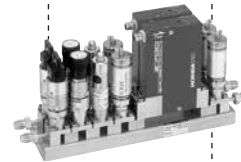
에어 오퍼레이터 밸브

매뉴얼 밸브

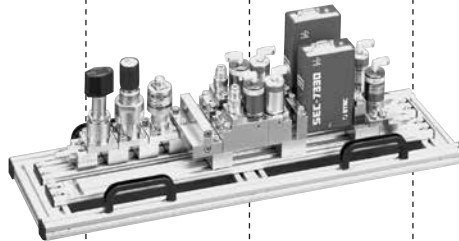
진동압력 제어 밸브

사용상의 주의사항

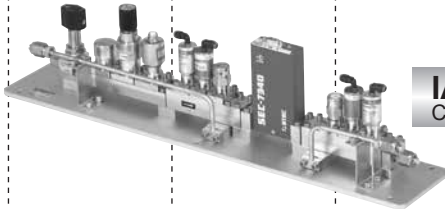
관련 기기



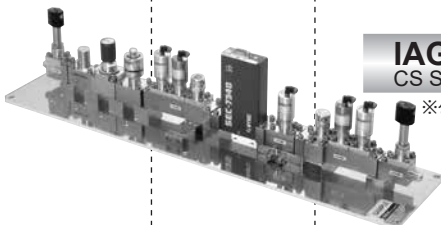
IAGD5
1.125인치 사이즈, W Seal



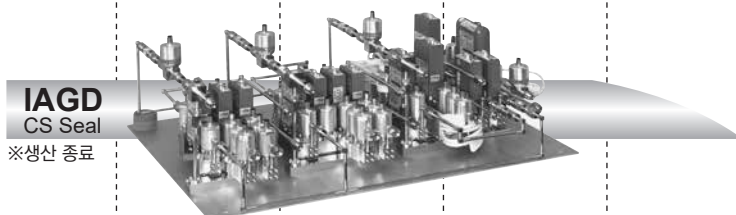
IAGD4
1.5인치 사이즈, W Seal



IAGD3
CS Seal

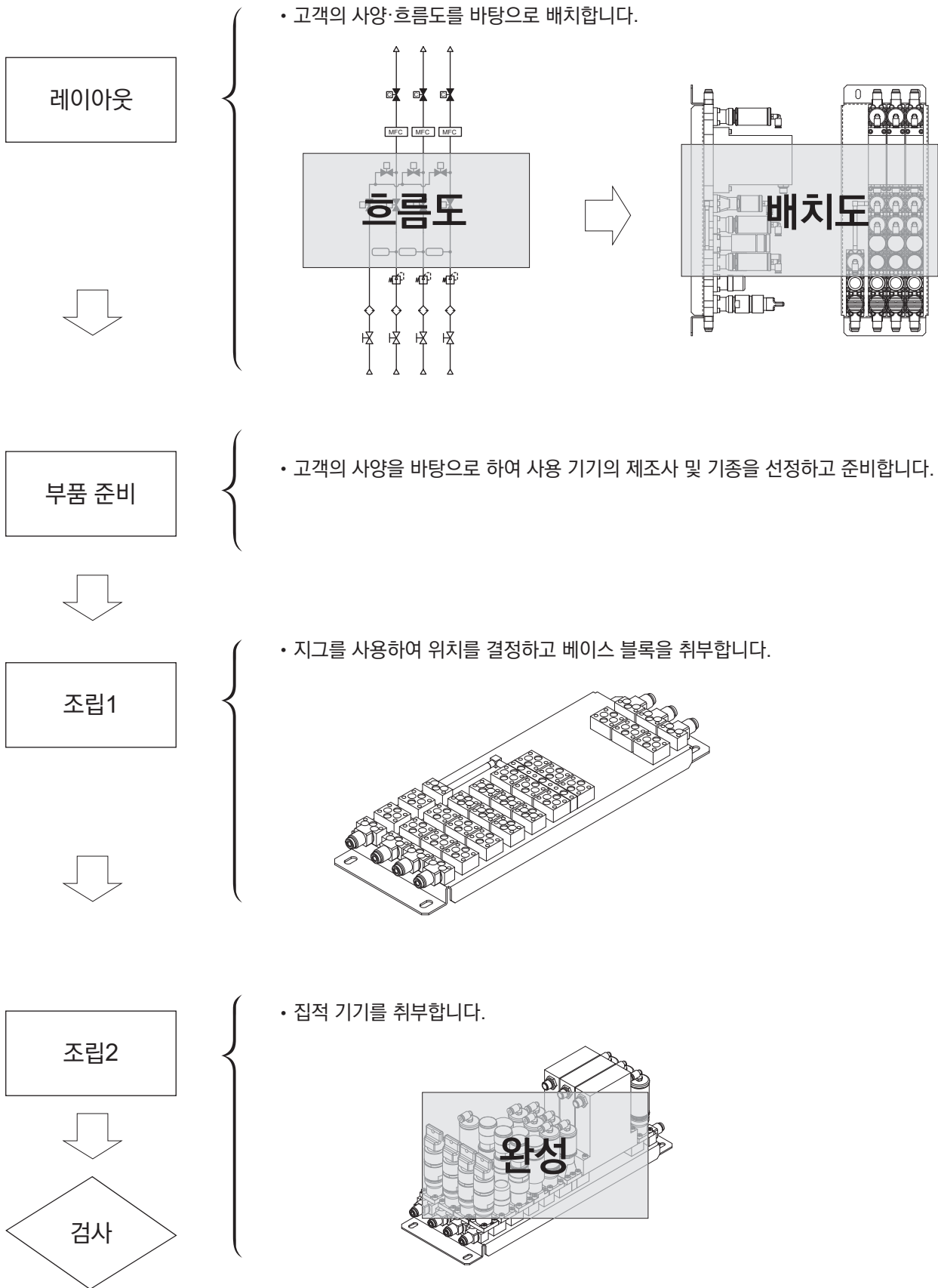


IAGD2
CS Seal
※생산 종료



IAGD
CS Seal
※생산 종료

집적화 가스 공급 시스템 제작 흐름



LGD 시리즈

AGD / OGD / MGD R 시리즈

고내구 타입

프로세스 가스용 기기
기타 프로세스
가스용 밸브

레귤레이터

집적화 가스
공급 시스템

사용상의
주의 사항

에어 오퍼레이터
밸브

매뉴얼
밸브

고진공용 기기
진공 압력 제어
밸브

사용상의
주의 사항

관련 기기